

快速退火炉 RTP 设备

AG Heatpulse 4100 Rapid Thermal Processor

设备型号: AG Heatpulse 4100/4100S

传片方式: Automatic Single wafer

设备状态: Complete Fully Refurbished

衬底材料: Si/SiC/GaAs/InP

材料尺寸: 4/5/6/圆片

测温方式: 热电偶 (200-900°C) 或者高温计测温 (500-1250°C)

升温速率: 10-100°C/S, Susceptor Box: 0-20°C/S

气路配置: 2 gas lines with 2 MFC. N₂, O₂ or Ar(可扩展, 最多 4 路气体 MFC)

恒温时间: 1-600S 设定

温度重复性: + 7°C or better at 1150°C wafer to wafer. (Repetition specifications are based on a 100-wafer set.)

温度均匀性: + 10°C across an 6-inch wafer at 1150°C. (This is a 1-sigma deviation from 100-angstrom oxide uniformity.) For a titanium silicidation process, no more than 1.5 percent increase to uniformity during the first anneal at 650 – 700°C.

选配功能:

*全新机械手及模块

*全新氧气分析仪 (0-10PPM)

* EAP/GEM/SECS II 功能(Software)

*全新气体管路最多增加至4路MFC

*全新 SiC/GaAs/InP 及透明材料传动模块

*全新 Susceptor Box

*全新低温 TC 测温控制系统(200-900°C)

设备硬件标准配置清单				
序号	配置名称	配置规格	配置数量	备注
1	快速退火炉主机	AG Heatpulse 4100	1 套	NEW
2	设备金属腔体	OEM	1 套	NEW
3	设备气路控制系统	OEM	1 套	NEW Parker 调压阀 /Fujikin 气动阀
4	AC 及 DC 电源组件	OEM	1 套	NEW
5	机械手 Robot	ATM	1 套	Refurbished
6	控制器 Controller	ESC	1 套	Refurbished
7	图形界面操作系统		1 套	NEW
8	工控主机/显示器		1 套	NEW
设备易损件随货标准配置清单				
序号	配置名称	配置规格	配置数量	备注
1	6 英寸石英工艺腔体	OEM	1	NEW
2	6 英寸石英工艺支架	OEM	1	NEW





全新 AC/DC 电源模块



全新气体管路



全新 MFC 管路



全新金属腔体及管路



全新加热灯管及腔体镀金



全新中控传动平台